

## OAR ～輸入実験用コンポーネント

取扱メーカー(代理店業務)



英国オックスフォードアプライドリサーチ社

表面科学・ナノサイエンス研究用機器製品

薄膜成膜の為のUHV/HVコンポーネントを得意としております

### ミニ e-ビームエバポレータ

ミニ e-ビームエバポレータ EGシリーズは高純度膜の作製に適しており、蒸着レートは高度な制御が可能で、多くの材料に対して0.1～50 Å/minの範囲でコントロール出来ます



#### <用途>

- 数nmの薄膜作製、半導体ドーピング

#### <特徴>

- 冷却効率でコンタミネーションフリーの設計
- 材料はロッドまたはルツボ充填の選択
- 標準搭載のフラックスモニタリングプレートにより精密な膜厚コントロールが可能
- 1、4ポケットのタイプ 4ポケットタイプは各ポケットの独立制御で同時蒸着も可能なタイプあり

### サドルフィールド型アトムソース (旧VSW Atomtech社商品)

サドルフィールド型アトムソースは電荷を持たない中性の直線ビームを成生します  
基盤のクリーニング、スパッタ、エッチングなど幅広い方法で使用できます



#### <用途>

- 成膜前の基板クリーニング
- 常温接合前のサンプルのクリーニング、表面の活性化
- 半導体基板等のエッチング
- 微細加工
- リアクティブアトムビームエッチング

#### <特徴>

- 絶縁物や半導体試料へのダメージ低減
- 無電荷ビームのため、電場や磁場中でも曲がらず直進

### ピエゾエレクトリックガスドージャー PLV1000

オールメタル極微量リークバルブで内蔵された圧電素子を用いて制御されます



#### <用途>

- 極微量ガス導入
- MBEガス導入
- ガスパルシング
- システム圧力コントロール

#### <特徴>

- リモートコントロール
- オールメタル
- 極微量コントロール
- PCコントロール